

の pH が低下すると液中の溶解性無機性炭素が負相へ炭酸ガスとして放出され、TIC濃度が減少する結果となる。有機酸に対する除去率は各希釈率、各S₀の系では98%以上で、ほぼ一定と仮定せる。混合液中に含まれている炭酸ガスの量を測定したTIC濃度から計算すると、図-2の修正値のようになる。これは酢酸を嫌気性消化した場合の理論的なメタンと炭酸ガスの比が1:1になることに一致する。即ち、メタン含有率は50%で、希釈率とS₀に依存せず一定である。図-3において示されたようにメタン比生成速度と比基質負荷速度(単位MLVSS当りの基質負荷速度)の関係はS₀と希釈率に依存せず、線形回帰直線の傾きから基質としての酢酸1mgの生産物としてのメタンへの転換割合は一定で0.23mgであることがわかる。図-4よりメタンガス比生成速度に及ぼす希釈率の影響を考察すると、S₀と希釈率が増加するに従って、メタンガス比生成速度は増加するが、低希釈率ではこの傾向は成立しないことがわかる。酢酸からメタンへの転換率はS₀と希釈率に依存せず、ほぼ一定で0.85である。即ち、1 moleの酢酸が除去される際、0.85 moleのメタンが生成される。図-5は比消費速度(D)と比増殖速度である希釈率の関係をプロットしたものであり、図-4に示したメタン比生成速度と希釈率の関係によく類似している。酢酸から菌体を生成する割合、真の増殖収率(Y_G)と自己分解係数(k_d)が、希釈率(即ち、見掛けの比増殖速度)に依存せず一定であると仮定すると、Xを菌体濃度として定常状態の菌体の物質収支式から次式が導かれる：
$$\mu = \frac{(S_0 - S)}{X} D = \frac{1}{Y_G} D + \frac{k_d}{Y_G}$$
(Sは槽内基質濃度)。もし、μと希釈率がこの式に従って線形性を満足しているならば、その回帰直線の切片と傾きから、Y_Gとk_dが評価できる。しかし、図-5のように線形性は満足されない。これは希釈率の違いによって細菌相が遷移し、Y_G、k_dが変化するたと解釈される。図-6には見掛けの増殖収率Y_sと希釈率の関係を示した。見掛けの増殖収率は希釈率が増加するにつれて増加するが、0.10/day以上の希釈率ではほぼ一定となることを示しているが、他の細菌のそれと比較して約1/4小さい値であることが知られる。比消費速度μがMonodモデルに従うと仮定すると、μの基質依存性は $\mu = \frac{\mu_{max} S}{K_s + S}$ のように示される。この式を逆数変換して、Hofsteeプロットの形にすると、
$$\frac{S}{\mu} = \frac{K_s}{\mu_{max}} + \frac{S}{\mu_{max}}$$
 のようになり、槽内基質濃度(S)の定常値とμから図-7が得られる。この図より最大比消費速度μ_{max}は8.52 mg酢酸/mg.VSS-day、基質飽和定数は170 mg酢酸/lと決定され、過去の報告されている値と比較してよく一致する。メタン生成菌は形態学上大きく2種類にわけられ、本実験の場合、希釈率の0.15/day以上では桿菌が優占となり、それ以下の希釈率の系では桿菌が優占となった。従って、桿菌と球菌が遷移する臨界の希釈率域はD=0.1~0.15/dayの間にいると考えられる。
 (1) Lawrence and McCarty (2) 小松、松本、野地 (3) 高尾、松本、野地
 WPCF Vol. 41 No.2 (1969) 第33回年譜(1978) 第34回年譜(1979)

